

**文部科学省 ナノテクノロジープラットフォーム 微細構造解析プラットフォーム  
名古屋大学 機器利用料**

2019年4月1日

単位:円

I 1時間あたりの使用料

|    | 機器等名称                                                   | 学 内 者 | 学 外 者 |        | 備考 |
|----|---------------------------------------------------------|-------|-------|--------|----|
|    |                                                         |       | 非営利法人 | 営利法人   |    |
| 1  | 反応科学超高压走査透過電子顕微鏡システム<br>JEM-1000K RS                    | 2,600 | 3,500 | 10,300 |    |
|    | (オプション)研究成果非公開使用料                                       | ---   | 4,200 | 12,500 |    |
| 2  | 高電圧用収差補正開発試験装置(収差補正電子顕微鏡)<br>EM-10000BU                 | 1,100 | 1,500 | 5,100  |    |
|    | (オプション)研究成果非公開使用料                                       | ---   | 1,800 | 6,200  |    |
| 3  | 高分解能電子状態計測走査透過型電子顕微鏡システム(収差補正電子顕微鏡)<br>JEM-ARM200F Cold | 1,100 | 1,500 | 4,900  |    |
|    | (オプション)研究成果非公開使用料                                       | ---   | 1,800 | 5,900  |    |
| 4  | 電子分光電子顕微鏡<br>JEM-2100M                                  | 900   | 1,300 | 5,200  |    |
|    | (オプション)研究成果非公開使用料                                       | ---   | 1,600 | 6,300  |    |
| 5  | 高分解能透過型電子顕微鏡システム<br>JEM-2100F/HK                        | 700   | 1,000 | 4,200  |    |
|    | (オプション)研究成果非公開使用料                                       | ---   | 1,200 | 5,100  |    |
| 6  | 走査電子顕微鏡<br>Quanta200FEG                                 | 500   | 800   | 4,200  |    |
|    | (オプション)研究成果非公開使用料                                       | ---   | 1,000 | 5,100  |    |
| 7  | 環境実験用観察装置 MP-66100(走査電子顕微鏡)<br>JSM-6610A                | 400   | 600   | 2,200  |    |
|    | (オプション)研究成果非公開使用料                                       | ---   | 700   | 2,700  |    |
| 8  | 直交配置型高速加工観察分析装置(FIB-SEM)<br>MI4000L                     | 1,600 | 2,200 | 5,300  |    |
|    | (オプション)研究成果非公開使用料                                       | ---   | 2,700 | 6,400  |    |
| 9  | バイオ/無機材料用高速FIB-SEMシステム<br>ETHOS NX5000                  | 1,600 | 2,200 | 5,600  |    |
|    | (オプション)研究成果非公開使用料                                       | ---   | 2,700 | 6,800  |    |
| 10 | 集束イオンビーム加工機(FIB)<br>FB-2100                             | 1,200 | 1,700 | 3,800  |    |
|    | (オプション)研究成果非公開使用料                                       | ---   | 2,100 | 4,600  |    |
| 11 | アルゴンイオン照射試料作成装置<br>クロスセクションポリッシャー                       | 200   | 400   | 800    |    |
|    | (オプション)研究成果非公開使用料                                       | ---   | 500   | 1,000  |    |
| 12 | 金属イオン照射試料作成装置<br>PIPS-II                                | 200   | 400   | 700    |    |
|    | (オプション)研究成果非公開使用料                                       | ---   | 500   | 800    |    |
| 13 | クライオマイクローム<br>LEICA EM UC7                              | 200   | 400   | 600    |    |
|    | (オプション)研究成果非公開使用料                                       | ---   | 500   | 700    |    |

機器使用料は、文部科学省「ナノテクノロジープラットフォーム事業(微細構造解析PF)」の採択により補助され、軽減されております。  
2022年3月31日の事業終了(予定)後は、通常の料金設定となります。

- 1 基本使用料は機器利用1時間あたりの利用料です。
- 2 非公開使用料は、機器利用1時間あたりのオプション料金であり、基本料金に別途加算します。
- 3 利用料金には消費税が含まれています。

II 解析手数料(単位:円):EDX,EELS,EBSD,ED,GL,Amira,3次元像の構築、解析結果報告書の作成等の場合に、基本料金に別途加算

|        |       |
|--------|-------|
| 1時間当たり | 6,500 |
|--------|-------|

III コンサルティング料(単位:円):非公開利用、立ち合い実験、研究・技術相談等の場合に基本料金に別途加算

|             |         |
|-------------|---------|
| 3時間未満       | 65,000  |
| 3時間以上～6時間未満 | 162,500 |
| 6時間以上～8時間   | 260,000 |